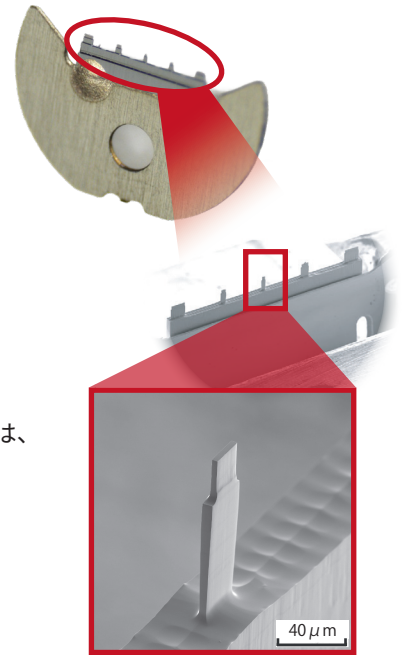


日立高性能FIB-SEM複合装置

TEM 試料作製用 高精度試料台

ナノメッシュ(NANOMESH[®]※1)

超微細・高精度な試料固定部で
TEM試料の作製をより正確に
スムーズに行うことが可能になります。

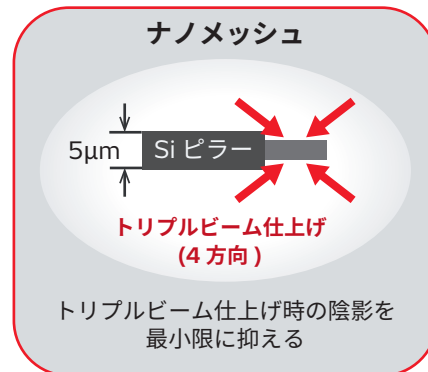
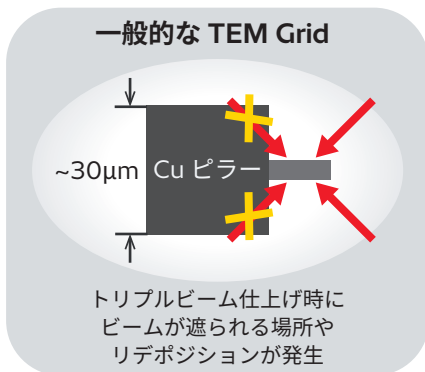


ナノメッシュの特徴

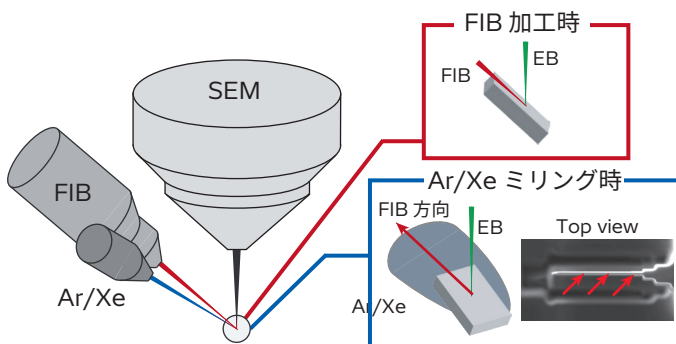
- 厚さ 5μm の超平滑面を持つ試料固定部
試料を試料固定部の上面または側面に固定することができます。
- 試料固定部は単結晶シリコン製
試料固定部の材質は単結晶シリコン製です。特にシリコン系の材料を EDX 分析するときは、台座からバックスパッタされる成分もシリコンであるため、元々含有しているシリコン以外の物質の検出を正確に行うことが可能です。
- 突出した固定部
FIB での薄片化時における逆スパッタリング（リデポジション）の影響を低減できます。

アプリケーション例

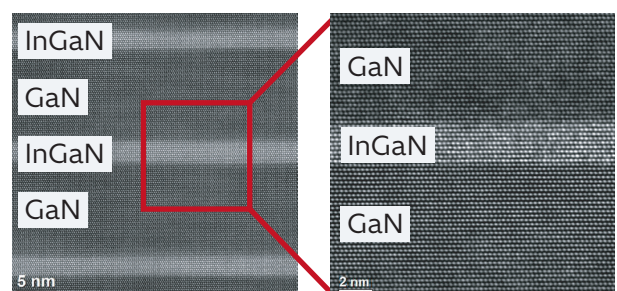
- 固定部先端厚みの差によるトリプルビーム仕上げ時の比較



- ナノメッシュを用いた Ar 仕上げの加工例



多重量子井戸の Ar 仕上げ加工後の STEM 像



仕様説明

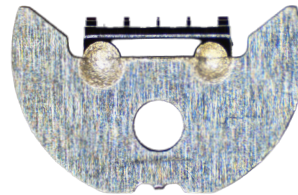
ナノメッシュ



数量	25 個 / 組
固定部先端厚み	5μm
固定部先端幅	100μm、50μm、30μm、20μm
固定部本数	5 本 (100μm×2 本)
固定部材質	単結晶シリコン
基板厚み	50μm
基板直径	3mmφ
基板材質	モリブデン
固定部と基板部間の導通	保証なし

ナノメッシュAA

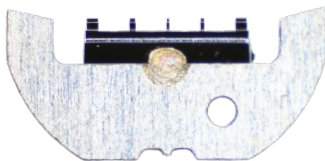
ナノメッシュと同じ形状で導通保証あり。
導通により TEM 試料との接触検知に使用可能。



数量	10 個 / 組
固定部先端厚み	5μm
固定部先端幅	100μm、50μm、30μm、20μm
固定部本数	5 本 (100μm×2 本)
固定部材質	単結晶シリコン
基板厚み	50μm
基板直径	3mmφ
基板材質	モリブデン
固定部と基板部間の導通	保証あり (期限付き)

ナノメッシュCC

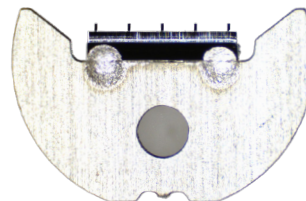
固定部の先端が中心付近になるように設計した形状で
導通保証あり。導通により TEM 試料との接触検知に使用可能。



数量	10 個 / 組
固定部先端厚み	5μm
固定部先端幅	100μm、50μm、30μm、20μm
固定部本数	5 本 (100μm×2 本)
固定部材質	単結晶シリコン
基板厚み	50μm
基板直径	3mmφ
基板材質	モリブデン
固定部と基板部間の導通	保証あり (期限付き)

ナノメッシュAPT

アトムプローブ顕微鏡用に設計したナノメッシュ。



数量	10 個 / 組
固定部先端厚み	3μm
固定部先端幅	3μm
固定部本数	5 本
固定部材質	単結晶シリコン
基板厚み	45μm
基板直径	3mmφ
基板材質	モリブデン
固定部と基板部間の導通	保証あり (期限付き)

詳細は弊社サービスエンジニアまでお問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社 日立ハイテックフィールドینگ

〒105-6410 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

URL www.hitachi-hightech.com/hfd/

部品・消耗品に関するお問い合わせ

 **0120-224-421**

 **S.I.navi** 日立ハイテック会員制サイト (エスアイナビ)
<https://biz.hitachi-hightech.com/sinavi/>

●本カタログに掲載の内容は、予告なく変更することがあります。

本カタログは2026年4月現在のものです。

DS2604004Rev.00

©Hitachi High-Tech Fielding Corporation. 2026. All Rights Reserved.